

簡単操作で“表面粗さ”と“輪郭形状”の測定が可能!

- 可搬性/設置自由度が高い測定機です。
- リアルタイムでプロフィールを表示・記録できます。
- 多様なパラメータに対応し、複数規格を同時解析。(表面粗さ測定)
- 測定サンプル数が64,000点と多く、高分解能で長距離の測定が可能です。(輪郭形状測定)
- 輪郭形状解析システムとの接続で、さらに高度な解析が可能です。(オプション)

Surface Roughness / Contour Measuring Instrument.

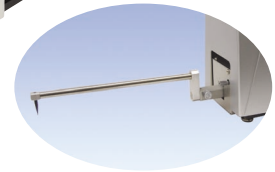
- Portable type Measuring Instrument.
- Surface profile can be displayed in real time.
- The unit can output the parameters based on multiple standards at one time.(Roughness Measurement)
- High resolution (Max. Sampling points : 64,000 points) and long measuring distance.(Contour Measurement)
- By Form Graphic Analysis Software (option), the data can be analyzed through PC.



※表面粗さ測定用
※For Roughness Measurement



SEF580-M50

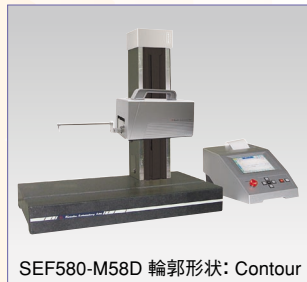


※輪郭形状測定用
※For Contour Measurement

拡張組合せ Various combinations



SEF580-M58 輪郭形状: Contour



SEF580-M58D 輪郭形状: Contour

仕様

型式	SEF580-M50	SEF580-M58	SEF580-M58D
測定パラメータ	Ra, Rz, Rt, Rp, Rv, RSm, Rq, Rsk, Rku, Rmr (c), Rmr, Rdc, RΔq, Rc, Ry, Rmax, Rpm, Rk, Rvk, Rpk Pa, Pz, Pt, Pp, Pv, PSm, Pq, Psk, Pku, Pmr (c), Pmr, Pdc, PΔq, Pc, PPI Wa, Wz, Wt, Wp, Wq, Wmr (c), WSm, Wca, Wcm, Sm, S, tp, Htp, Δq, Δa, HSC, λa, λq, Mr1, Mr2, A1, A2		
測定範囲	縦: 800μm 横: 50mm 縦方向分解能: 0.08nm		
測定倍率	縦: 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 自動 横: 1~1,000, 自動		
カットオフ値	粗さ λc 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0mm λs 各規格に準拠 うねり λf 0.8, 2.5, 8.0, 25.0mm		
フィルタ	ガウシヤン, 2CR, 特殊ガウシヤン		
オートレベルリング	全域, 前半, 後半, 中心, 2点, パラボラ		
測定長さ	評価長さ方式 λc×1~×5, 及び×n (n: 最大81) 基準長さ方式 0.25, 0.8, 2.5mm及び任意長さ0.1mm毎		
送り速度	0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0mm/s		
主な機能	合否判定, 統計処理, 再演算, 切り欠き処理, メートル/インチ		
検出器	触針: R2μm タイタニウム 測定力0.75mN以下 頂角60°スキッド: R40mm サファイヤ		
指示精度	Z: ±(2.5+0.5× H)μm以下 H: 変位 (mm) X: ±(2.5+0.02L)μm以下 L: 測定長さ (mm)		
分解能	Z: 0.25μm X軸スケール: 0.1μm		
サンプリング数/最小間隔	Max 64,000点 / Min 0.5μm		
測定範囲/表示倍率	縦(Z): 30mm 横(X): 50mm 縦(Z), 横(X): 1~2000倍		
測定項目・補助機能	距離, ピッチ, 角度, 円, アライメント, スタイラス半径校正, レイアウト印刷 (プロッタ出力時), 解析マクロ他		
送り速度	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.2mm/s		
真直度測定精度	3.5μm/50mm以下 (弊社規格)		
追従角度	登り: 75° (滑らかな面) 下り: 80°		
検出器	スタイラス先端: R25μm 超硬 斧型 測定力: 10~30mN (スタイラスアームの種類により固定)		
検出器上下動/範囲	—		電動・手動上下動/250mm
設置寸法・質量	測定装置部: W270×D120×H135mm 約6.3kg 解析制御部: W240×D405×H190mm 約6kg	W1,500×D850mm 測定装置部: 約80kg 解析制御部: 約6kg	
電源	単相 AC90~240V 50/60Hz 200VA		

Specifications

Model	SEF580-M50	SEF580-M58	SEF580-M58D
Measurement Parameters	Ra, Rz, Rt, Rp, Rv, RSm, Rq, Rsk, Rku, Rmr (c), Rmr, Rdc, RΔq, Rc, Ry, Rmax, Rpm, Rk, Rvk, Rpk Pa, Pz, Pt, Pp, Pv, PSm, Pq, Psk, Pku, Pmr (c), Pmr, Pdc, PΔq, Pc, PPI Wa, Wz, Wt, Wp, Wq, Wmr (c), WSm, Wca, Wcm, Sm, S, tp, Htp, Δq, Δa, HSC, λa, λq, Mr1, Mr2, A1, A2		
Measuring Range	Vertical: 800μm Horizontal: 50mm Vertical Resolution: 0.08nm		
Magnification	Vertical: 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, Auto Horizontal: 1~1,000, Auto		
Cut Off	Roughness λc 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0mm λs Conform to each standard Waviness λf 0.8, 2.5, 8.0, 25.0mm		
Filter	Gaussian, 2CR, Special Gaussian		
Auto Leveling	All Range, First Half, Second Half, Central Half, Two Points, Parabola		
Measuring Length	Evaluation Length Method λc×1~×5, ×n (n: Max81)/0.25, 0.8, 2.5mm, Manual setting (0.1mm Step)		
Drive Speed	0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0mm/s		
Analysis Items	Judgment, Statistical Analysis, Recalculation, Notch Processing, Unit Changeover (mm/inch)		
Pick-Up	Stylus: R2μm, Diamond, Measuring Force: 0.75mN or Less, Tip Angle 60° Skid Radius: R40mm, Sapphire		
Accuracy	Z: ±(2.5+0.5× H)μm or Less H: Displacement (mm) X: ±(2.5+0.02L)μm or Less L: Measuring Length (mm)		
Resolution	Z: 0.25μm X Axis scale: 0.1μm		
Sampling Points/Pitch	Max 64,000 Points / Min 0.5μm		
Measuring Range/Magnification	Vertical: 30mm Horizontal: 50mm Vertical, Horizontal: 1~2000		
Analysis Items/Data Connect Functions	Distance, Pitch, Angle, Circle, Alignment, Layout Print (Plotter Only), Analysis Macro etc.		
Drive Speed	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.2mm/s		
Straightness	3.5μm/50mm or Less (Our Standard)		
Traceable Angle	Ascend: 75° (Smooth Surface) Descend: 80°		
Pick-Up	Stylus: R25μm, Tungsten Carbide, Axe Type, Measuring Force: 10~30mN (Stylus Force is fixed depend on the type of stylus arm.)		
Pick-up Up-Down / Range	—		Manual Up-Down / 250mm
Install Size / Weight	Measuring Unit: W270×D120×H135mm Approx 6.3kg Amplifier: W240×D405×H190mm Approx 6kg	W1,500×D850mm Measuring Unit: Approx 80kg Amplifier: Approx 6kg	
Power Supply	AC90~240V 50/60Hz 200VA		